

# XM-60 和 XM-600 多光束校正儀

只需設定一次便能以任何方向量測六個自由度

## 獨一無二的技術、光學鏡組側轉角量測及光纖發射

XM 雷射量測系統只需設定一次，便能沿線性軸同時量測六個自由度的誤差。此系統是強大的診斷工具，只需擷取一次即可量測該軸的所有幾何誤差。

對空間補償或誤差修正的使用者而言，XM 雷射系統能以快速又精準的方式產生資料。所有量測作業皆為光學式，可於任意方向使用。

## XM 系統概述

### 靈活

獨立雷射裝置可讓安裝方式更靈活，還能大幅減少對量測總行程的影響。

### 熱穩定性

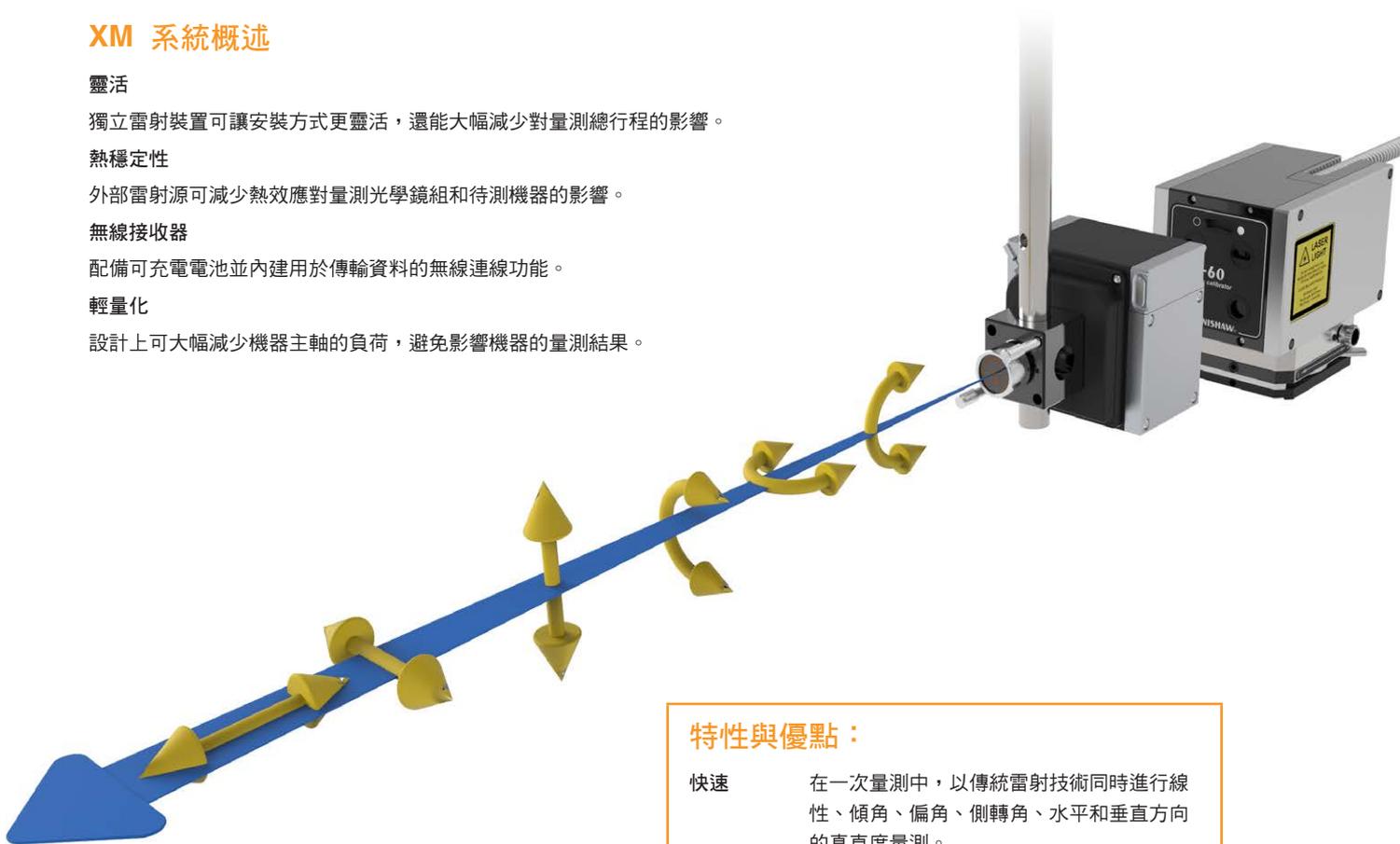
外部雷射源可減少熱效應對量測光學鏡組和待測機器的影響。

### 無線接收器

配備可充電電池並內建用於傳輸資料的無線連線功能。

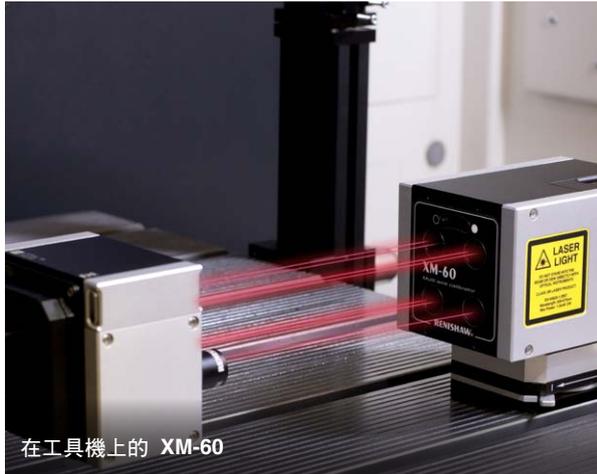
### 輕量化

設計上可大幅減少機器主軸的負荷，避免影響機器的量測結果。



## 特性與優點：

- |      |  |
|------|--|
| 快速   | 在一次量測中，以傳統雷射技術同時進行線性、傾角、偏角、側轉角、水平和垂直方向的真直度量測。      |
| 簡單   | 設定簡便，對其他干涉儀系統的使用者而言極為熟悉。<br>自動方向偵測和圖形化對準可有效減少人為疏失。 |
| 安心   | 直接量測所有誤差，讓使用者在測試期間即可查看結果。                          |
| 高功能性 | 獨特光學側轉角量測系統，能以任何方向進行側轉角量測。                         |



在工具機上的 XM-60

## XM-60

提供使用者強大的機器診斷功能，只需擷取一次即可量測所有自由度。使用者可藉由擷取六個自由度找出誤差來源，不像單獨執行線性量測時往往只會看到造成的影響。

CARTO 軟體套件可搭配 XM-60 使用，利用本身的自動化功能偵測機器的方向規則，進而輕鬆快速地擷取資料。此套件結合全方位分析軟體後，可比較誤差類型和時間範圍，提供詳盡的機器性能一覽。



在 CMM 上的 XM-600

## XM-600

XM-600 在設計上具備額外的功能，能直接與 Renishaw 的 UCC 控制器通訊，還可搭配 CARTO 軟體使用。如此一來便為 CMM 的每個線性軸輕鬆建立精準的誤差修正。

UCC 套件 V5.4.1 及更新版本均支援這項功能，讓您在半天內即可得出 CMM 的完整誤差對應。

## 相容性

軟體	XM-60	XM-600
CARTO 套件	是	是
UCC 套件	否	是

## 性能規格

	精度	解析度	範圍
線性	±0.5 ppm (含環境補償)	1 nm	0 m 至 4 m
角 (前後傾角/偏轉角)	±0.004A ±(0.5 μrad +0.11M μrad)	0.03 μrad	±500 μrad
真直度	一般距離：±0.01A ±1 μm 延長距離：±0.01A ±1.5 μm	0.25 μm	±50 μm ±250 μm
側轉角	±0.01A ±6.3 μrad	0.12 μrad	±500 μrad

附註：回報之精度值的統計可信度為 95% (k=2)。這些值不包括與讀數換算為 20°C 材料溫度的值有關的誤差。

A = 顯示的錯誤讀數

M = 測量距離以公尺為單位

有關全球聯繫之相關資訊，請上網站 [www.renishaw.com.tw/contact](http://www.renishaw.com.tw/contact)。

RENISHAW 竭力確保在發佈日期時，此份文件內容之準確性及可靠性，但對文件內容之準確性及可靠性將不做任何擔保。RENISHAW 概不會就此文件內容之任何不正確或遺漏所引致之任何損失或損害承擔任何法律責任。



L - 5103 - 4037 - 04 - C